

SECTION G — PHYSIQUE

G01 MÉTROLOGIE; ESSAIS

G01Q TECHNIQUES OU APPAREILS À SONDE À BALAYAGE; APPLICATIONS DES TECHNIQUES DE SONDE À BALAYAGE, p.ex. MICROSCOPIE À SONDE À BALAYAGE [SPM] [2010.01]

Note(s) [2010.01]

Dans la présente sous-classe, la règle de la priorité à la première place s'applique, c. à d. qu'à chaque niveau hiérarchique, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la première place appropriée.

- | | |
|---|--|
| <p>10/00 Dispositions pour le balayage ou le positionnement, c. à d. dispositions pour commander de manière active le mouvement ou la position de la sonde [2010.01]</p> <p>10/02 • Balayage ou positionnement grossier [2010.01]</p> <p>10/04 • Balayage ou positionnement fin [2010.01]</p> <p>10/06 • • Circuits ou algorithmes à cet effet [2010.01]</p> <p>20/00 Contrôle du mouvement ou de la position de la sonde [2010.01]</p> <p>20/02 • par des moyens optiques [2010.01]</p> <p>20/04 • Sondes auto-déetectrices, c. à d. dans lesquelles la sonde génère elle-même un signal représentatif de sa position, p.ex. jauge piézoélectrique [2010.01]</p> <p>30/00 Moyens auxiliaires destinés à assister ou améliorer les techniques ou les appareils à sonde à balayage, p.ex. dispositifs d'affichage ou de traitement de données [2010.01]</p> <p>30/02 • Dispositifs d'analyse d'un type autre que la microscopie à sonde à balayage SPM, p.ex. microscope électronique à balayage SEM [Scanning Electron Microscope], spectromètre ou microscope optique [2010.01]</p> <p>30/04 • Dispositifs d'affichage ou de traitement de données [2010.01]</p> <p>30/06 • • pour compensation d'erreurs [2010.01]</p> <p>30/08 • Moyens pour établir ou réguler des conditions ambiantes souhaitées au sein d'une enceinte d'échantillonnage [2010.01]</p> <p>30/10 • • thermiques [2010.01]</p> <p>30/12 • • avec fluide [2010.01]</p> <p>30/14 • • • avec liquide [2010.01]</p> <p>30/16 • • sous vide [2010.01]</p> <p>30/18 • Moyens pour protéger ou isoler l'intérieur d'une enceinte d'échantillonnage contre les conditions ou les facteurs environnementaux externes, p.ex. les vibrations ou les champs électromagnétiques [2010.01]</p> <p>30/20 • Dispositifs ou procédés de manipulation d'échantillons [2010.01]</p> <p>40/00 Étalonnage, p.ex. des sondes [2010.01]</p> <p>40/02 • Leurs normes d'étalonnage ou procédés de fabrication [2010.01]</p> <p>60/00 Types particuliers de microscopie à sonde à balayage SPM [Scanning-Probe Microscopy] ou appareils à cet effet; Composants essentiels de ceux-ci [2010.01]</p> | <p>60/02 • Microscopie à sonde à balayage de type multiple, c. à d. incluant au moins deux techniques SPM [2010.01]</p> <p>60/04 • • Microscopie à effet tunnel à balayage STM [Scanning Tunnelling Microscopy] combinée avec la microscopie à forces atomiques AFM [Atomic Force Microscopy] [2010.01]</p> <p>60/06 • • Microscopie optique à champ proche à balayage SNOM [Scanning Near-Field Optical Microscopy] combinée avec la microscopie à forces atomiques AFM [Atomic Force Microscopy] [2010.01]</p> <p>60/08 • • Microscopie à forces magnétiques MFM [Magnetic Force Microscopy] combinée avec la microscopie à forces atomiques AFM [Atomic Force Microscopy] [2010.01]</p> <p>60/10 • Microscopie à effet tunnel à balayage STM [Scanning Tunnelling Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes STM [2010.01]</p> <p>60/12 • • Spectroscopie à effet tunnel à balayage STS [Scanning Tunnelling Spectroscopy] [2010.01]</p> <p>60/14 • • Potentiométrie à effet tunnel à balayage STP [Scanning Tunnelling Potentiometry] [2010.01]</p> <p>60/16 • • Sondes, leur fabrication ou leur instrumentation correspondante, p.ex. supports [2010.01]</p> <p>60/18 • Microscopie optique à champ proche à balayage SNOM [Scanning Near-Field Optical Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes SNOM [2010.01]</p> <p>60/20 • • Fluorescence [2010.01]</p> <p>60/22 • • Sondes, leur fabrication ou leur instrumentation correspondante, p.ex. supports [2010.01]</p> <p>60/24 • Microscopie à forces atomiques AFM [Atomic Force Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes AFM [2010.01]</p> <p>60/26 • • Microscopie à forces de frottement [2010.01]</p> <p>60/28 • • Microscopie à forces d'adhérence [2010.01]</p> <p>60/30 • • Microscopie à mesure de potentiel à balayage [2010.01]</p> <p>60/32 • • Mode vibrant [2010.01]</p> <p>60/34 • • • Mode à contact périodique [2010.01]</p> <p>60/36 • • Mode statique [2010.01]</p> <p>60/38 • • Sondes, leur fabrication ou leur instrumentation correspondante, p.ex. supports [2010.01]</p> <p>60/40 • • • Sondes conductrices [2010.01]</p> <p>60/42 • • • Fonctionnalisation [2010.01]</p> <p>60/44 • Microscopie à conductance ionique à balayage SICM [Scanning Ion-Conductance Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes SICM [2010.01]</p> |
|---|--|

G01Q

- 60/46 • Microscopie capacitive à balayage SCM [Scanning Capacitance Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes SCM [2010.01]
- 60/48 • • Sondes, leur fabrication ou leur instrumentation correspondante, p.ex. supports [2010.01]
- 60/50 • Microscopie à forces magnétiques MFM [Magnetic Force Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes MFM [2010.01]
- 60/52 • • Résonance [2010.01]
- 60/54 • • Sondes, leur fabrication ou leur appareillage connexe, p.ex. supports [2010.01]
- 60/56 • • • Sondes à revêtement magnétique [2010.01]
- 60/58 • Microscopie thermique à balayage SThM [Scanning Thermal Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes SThM [2010.01]
- 60/60 • Microscopie électrochimique à balayage SECM [Scanning Electro-Chemical Microscopy] ou appareils à cet effet, p.ex. sondes SECM [2010.01]
- 70/00 **Aspects généraux des sondes SPM, leur fabrication ou leur instrumentation correspondante, dans la mesure où ces sondes ne sont pas spécialement adaptées à une seule technique SPM couverte par le groupe G01Q 60/00 [2010.01]**
- 70/02 • Supports de sondes [2010.01]
- 70/04 • • à compensation des erreurs induites par la température ou les vibrations [2010.01]
- 70/06 • Réseaux de pointes de sondes [2010.01]
- 70/08 • Caractéristiques des sondes [2010.01]
- 70/10 • • Forme ou cônité [2010.01]
- 70/12 • • • Pointes de nanotubes [2010.01]
- 70/14 • • Matériaux particuliers [2010.01]
- 70/16 • Fabrication des sondes [2010.01]
- 70/18 • • Fonctionnalisation [2010.01]
- 80/00 **Applications des techniques de sonde à balayage, autres que les techniques SPM** (fabrication ou traitement des microstructures B81C; fabrication ou traitement des nanostructures B82B 3/00; enregistrement ou reproduction d'informations utilisant des interactions en champ proche G11B 9/12, G11B 11/24 ou G11B 13/08) [2010.01]
- 90/00 **Techniques ou appareils à sonde à balayage non prévus ailleurs [2010.01]**